CLIPPEDIMAGE= JP401106456A

PAT-NO: JP401106456A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01106456 A

TITLE: SEMICONDUCTOR INTEGRATED CIRCUIT DEVICE

PUBN-DATE: April 24, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KURODA, HIROSHI TAKASE, YOSHIHISA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP62263435

APPL-DATE: October 19, 1987

INT-CL (IPC): H01L023/50; H01L023/28

US-CL-CURRENT: 257/666,257/787

ABSTRACT:

PURPOSE: To make an electrode terminal not to come off due to external force and thermal strain by providing the end surface of a lead frame substrate with a stair part having more than one step and performing molding with sealing resin in a shape of covering the stair part.

CONSTITUTION: An IC chip 16 is mounted on the other main surface 14 of a die pad 11, and a pad of the IC chip and the other main surface 14 of an electrode terminal 12 are bonded with a wire 17 so as to be continuously molded with sealing resin 18 on the almost level with one main surface 13 by a transfer method so that the electrode terminal and the main surface 13 of the die pad 11 may be exposed. At this time, a stair part 15 provided on a lead frame 20 is also covered with sealing resin 18. Thereby, a reinforcing bar 19 exposed to an end surface of sealing resin 18 is also of the same projection type so as to have very strong structure against coming-off even to external force.

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-106456

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成1年(1989)4月24日

H 01 L 23/50 23/28 G-7735-5F A-6835-5F

謇査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

#### ❷発明の名称 半導体集積回路装置

创特 頤 昭62-263435

啓

**❷出 願 昭62(1987)10月19日** 

勿発 明者 黒 H 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

73発 明 者 高 瀬 善久 砂出 願 人 松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

四代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

1、発明の名称

半導体集積回路裝置

2、 特許請求の範囲

複数の電極端子を有するリードフレームの一主 面の面積が、他の主面より狭く、とのリードフレ ームの断面形状は少たくとも1段以上の食差を持 つ及差部を有するものであり、半導体集積回路は 他の主面にマウントされ、少なくとも電極端子の 一主面を奪出した形で一主面とほぼ平坦に封止樹 脂が成形されている半導体集積回路装置。

3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は半導体集積回路をパッケージした半減 体集積回路装置に関するものである。

従来の技術

ポータプルな情報ファイルとしてのICカード はカードの一部化メモリ、マイクロブロセッサを 有する半導体集費回路装置を埋込んで、リーダー ライタを介して情報を書き込み、読み出し、消去

する演算機能を持っているが、ISO規格により カード厚みは最大 0.84ミリとされており、当然 半導体集積回路装置は更に薄くしかも厚み精度が 強く要求される。

当初半導体集積回路装置の基板はガラスエポキ シを基体とする両面基板が主流であったが、ガラ スエポキシ基板ではICカード用半導体集積回路 装置に要求する厚み精度を十分に満足させるもの ではなかった。

そとでガラスエポキシ基板の代りに厚み精度が よく半導体集積回路装置の総厚の厚み精度も向上 させられるリードフレームを基板とするICカー ド用半導体集積回路装置が提案された。とのIC カード用半導体集積回路装置の構造を第4図に示 し説明する。

複数本の電極端子1とダイバッド2を有するり ードフレームBの上記ダイパッド2にIGチップ 3がマウントされ、上記ICチップ3のパッド (図示せず)と上記電極端子1がワイヤ4で接続 されており、少なくとも上記電極端子1の一主面 5 を露出した形で、しかも上記一主面 5 とほぼ平 坦に封止徴脂 6 がトランスファ 成形法により成形 された構造となっている。

ところが上記電極雄子1の上記の1年1日 5 仕外部に第出し、上記電極雄子1の輝い側面を含む片面しか上記對止樹脂のを接触していない。通常トランスファ成形法で成形する上記對止樹脂の中には成形を立てなることがあることがあることがあることが発性では、雄雅子1いのではない。と接触する他の主面でを担面化したり、上記電極子1の一主面の面積を他の主面でのます。とと接触する他の主面でのではより終くして、エッジにテーバをつけ合形形状とする)を着性の向上を図っている。

# 発明が解決しようとする問題点

このような半導体集積回路装置に用いるリードフレーム8の厚味は、半導体集積回路装置に総厚の制限があることからの、15ミリ以下が通常用いられる。ところが對止樹脂8とリードフレーム8

なる。との状態でカード化しカードの携帯中あるいは使用中に何らかの異物が切断面にできたべり、あるいは電極端子自体にひっかかり電極端子をはがしてしまり可能性がある。このように電極端子がはがれたり、変形するとICカードとしての機能が全く失なわれることになる。

本発明は上記問題点を載み、外的な力、熱ひず み等に対しても電極端子がはがれて使用不能にな らないようなリードフレームの構造を提供するも のである。

# 問題点を解決するための手段

そして上記問題点を解決する本発明の技術的手 要は、リードフレームの一主面の面積を他の主面 より終くし断面形状を凸型として一主面と怪ए平 坦に封止樹脂を成形し、リードフレームの韓面を 所定の距離、厚さでほぼ全辺にわたって封止樹脂 で覆りように構成したものである。

### 作用

この構成により電極端子のほぼ全辺が封止樹脂 でおおわれていることから、電極端子を刺す外部 の他の主面7との密着性を強化するために、リー ピフレームBの断面をテーパ加工し、わずかに針 止樹脂6 でリードフレームBを覆り形としている が、リードフレーム8の厚味が O.1 5ミリと非常 に薄いため、封止樹脂 B でリードフレーム B の強 面を一部覆り形とした場合でもせいぜい厚味分の O. 16ミリ程度しか覆うことができず、嬉面化テ ーパをつけても封止樹脂の化対するリードフレー ムBの密着強度を着るしく向上させることはでき なかった。また前にも述べたが封止樹脂6には麓 形剤が入っているため、リードフレーム8との密 着性が悪く、例えば熱衝撃試験を行った時に発生 する熱的ひずみによりリードフレーム8が剥れる 可能性も生じてくる。更にトランスファ成形後り ードフレーム8の補強パーを封止樹脂6の端面に 沿ってほぼ平坦に金型にて切断して個片の半導体 集積回路装置にするわけであるが、補強パーの切 断面は金型で切断する際、わずかをバリが発生す ることと、完全に封止樹脂6の蟾面と平坦にする ことは不可能で、わずかに切断面が突き出る形と

からの力が加わらず、また無衡撃試験等による無 ひずみに対しても電極端子が剥れることがないた め信頼性の高い半導体集積回路装置を作ることが 可能となる。

### 事前例

る構造のリードフレームである。このリードフレーム20の作数方法は一実施例として、まずプレス機でストレートにパンチングした後続いて別の金型を用い同じくプレス機によりリードフレーム20の嬉面のみをプレスし所定の量だけ段差部15を作った。他の方法としてエッチングによる方法でも同様の段差部15を作ることは可能である。以上の説明はICチップを搭載するダイパッド11を有するリードフレーム20であるが、ダイパッド11の無い電極端子12のみのリードフレームでもかまわない。

以上述べた段付きリードフレーム20を用いた 半導体集積回路装置の製造プロセスを第3図 & ~ c に示す。これは第2図の & - A'の断面を表わす ものである。ダイパッド11の他の主面14に I C チップ16をマウントし、上記IC チップ16 のパッド(図示せず)と上記電極端子12の他の 主面14をワイヤ17で接続し(第3図 & )、続いてトランスファ成形法にて上記電極端子12、 及びダイパッド11の一主面13を露出させるど

のではなく、パンプを利用したフリップチップポンディング方式でもかまわない。また同時にリードフレーム20の他の主面側をエッチング、サンドプラストメッキ法等で相面化処理が始とされていても良い。更にダイパッド11が無くICチップ16が電極端子12にかかるようなリードフレーム20を用いる場合はICチップ16をマウントするダイポンド徴脂は絶縁性であることはいうまでもない。

### 発明の効果

本発明の半導体集役回路装置はリードフレーム 基板の端面に1段以上の段差部を設け、段差部を 硬う形で封止樹脂にて成形しているため、外的な 力にも電極端子は剥れにくく、熱衝撃試験等の熱 ひずみに対しても、電極端子ははがれないことか ら、信頼性の高いものを得ることが可能となる。

# 4、図面の簡単左説明

第1図は本発明の半導体集積回路装置の一実施例における電磁端子部の拡大斜視図、第2図 a , b は本発明に用いたリードフレームの構造を示す

とく、上記一主面13とほぼ平坦に封止樹脂18 で成形する(第3凶り)。この時リードフレーム 20亿設けられた段差部15も上記封止樹脂18 で覆われる形となる。更に金型を用いて上記封止 樹脂18の婚面に沿って補強パー19を切断して 個片の半導体集積回路装置とする(第3図c)。 以上のペた半導体集積回路装置の電振端子部の拡 大図を第1図に示す。この第1図によれば電極端 子12の一主面と封止樹脂18はほぼ平坦に成形 されており、封止樹脂18に埋砂した電極端子12 の一部は、鵞出している一主面より広がっている 構造となっている。このことは、電極端子12の 端面に形成されている段差部16を完全に対止樹 盾1 B が覆っていることになり、封止樹窟1 B O 端面に露出している補強パー19も同様の凸型で あることから外的な力に対しても非常に剥れに強 い構造となっている。

以上述べてきた実施例の中でICチップ16の パッドと電極端子12の接続にワイヤ11を用い ているが、ワイヤーポンディング法に限定するも

上面図と断面図、第3図 a ~ c は本発明の半導体 集横回路装置の製造フローを示す断面図、第4図 は従来のリードフレームを用いた半導体集積回路 装置の構造を示す断面図である。

12……電極端子、13……一主面、14…… 他の主面、15……段差部、16……ICチップ、 17……ワイヤ、18……封止樹脂、19……補 強パー、20……リードフレーム。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名



